



سیلی گرافن های g-SiC و g-SiC₂ به عنوان حسگر چندوجهی گاز H₂S

حامد مهدوی نژاد^۱، رزا صفائی اسدآبادی^{۲*}، و محمدحسین شیخی^۱

۱. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز

۲. دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه شیراز، شیراز

پست الکترونیکی: safaiee@shirazu.ac.ir

(دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۰۴/۲۱؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲)

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی توانایی صفحات سیلی گرافن g-SiC و g-SiC₂ در آشکارسازی گاز سولفید هیدروژن از طریق سازو کارهای مختلف حسگری با استفاده از نظریه تابعی چگالی است. نتایج محاسبات ما نشان می دهد که فرایند جذب گاز روی هر دو صفحه سیلی گرافن فیزیکی و گرماده است. فرایند جذب فیزیکی باعث می شود که مواد حسگر بتوانند در زمان کوتاهی (حدود چند نانو ثانیه) پس از دفع گاز در دمای اتاق بازیابی شوند. بررسی خصوصیات هندسی و الکترونی ترکیب صفحات g-SiC و g-SiC₂ با مولکول گاز آشکار می سازد که هر دو ماده قابلیت آشکارسازی گاز از طریق سازو کارهای حرارتی و مقاومتی را دارند. برای مثال، هدایت الکتریکی صفحه g-SiC پس از جذب گاز ۳۸٪ تغییر می کند. به علاوه، حضور مولکول گاز روی اکثریت آن را تغییر داده و استفاده از این ماده را در ساخت حسگرهای مبتنی بر اثر سیبک ممکن می سازد. در مجموع، سازو کارهای حسگری متنوع به همراه زمان بازیابی اندک، صفحات سیلی گرافن g-SiC و g-SiC₂ را به نامزد مناسبی برای استفاده در ساخت حسگر گاز سولفید هیدروژن به عنوان ماده حسگر مبدل می سازد.

واژه های کلیدی: سیلی گرافن های g-SiC و g-SiC₂، حسگر H₂S، اثر سیبک، نظریه تابعی چگالی

تخم مرغ فاسد دارند [۴]. استنشاق این گاز می تواند سلامت

۱. مقدمه

انسان را با مخاطراتی جدی روبرو سازد از جمله این که حس بویایی انسان در غلظت های بالاتر از ۰/۴۱ ppb^۱ از آن آسیب می بیند [۲]. علاوه بر این، سولفید هیدروژن سامانه عصبی و تنفسی انسان را مختلف می کند. غلظت های بیش از ۱۰۰ ppm آن عصب بویایی را کاملاً فلنج می کند و وجود گاز در محیط احساس نمی شود. قابل ذکر است که استنشاق غلظت های بسیار بالا از گاز سولفید هیدروژن (حدود ۱۰۰۰ ppm) مرگ آنی را برای انسان رقم خواهد زد [۵]. بنابراین طراحی حسگری با سرعت عمل بالا و دارای توجیه اقتصادی برای گاز سولفید

حسگرهای گاز جایگاه مهمی در صنعت، سامانه های ایمنی و تجهیزات کنترل کیفیت هوا دارند. به کار بردن این دسته از حسگرها در محیط هایی با احتمال آلوگی به گازهای سمی و خطروناک اجتناب ناپذیر است [۳-۱]. یکی از این گازها سولفید هیدروژن (H₂S) می باشد که گاز خطروناکی است و معمولاً در بالایشگاه ها، تصفیه خانه ها و مکان های بازیافت زیاله حضور دارد. مولکول های این گاز سنگین تر از هوا، بی رنگ، بسیار سمی، فرساینده فلزات و قابل اشتعال هستند و بویی شبیه بوی

۱. Part per billion

۲. Part per million

نمی کند [۱۸]، زمان بازیابی حسگر سولفید هیدروژن مبتنی بر صفحه های سیلی گرافن مورد بحث، اندک خواهد بود. اندک بودن زمان بازیابی امکان استفاده از حسگر به دفعات را فراهم می آورد. بنابراین از منظر اقتصادی نیز طراحی و ساخت حسگر سولفید هیدروژن مبتنی بر صفحه های سیلی گرافن g-SiC و g-SiC₂ مقرن به صرفه خواهد بود.

در این مقاله، ابتدا جذب گاز سولفید هیدروژن روی صفحه های سیلی گرافن g-SiC و g-SiC₂ از دیدگاه نظری و با استفاده از نظریه تابعی چگالی^۱ (DFT) و نرم افزار کوانتم اسپرسو^۲ [۱۹] مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس نتایج به دست آمده، سازوکارهای مختلف آشکارسازی گاز توسط این صفحه ها معرفی شده است. از جمله نتایج مهم حاصل از این پژوهش می توان به امکان آشکارسازی گاز سولفید هیدروژن از طریق سازوکار اثر سیبیک توسط حسگر مبتنی بر g-SiC و سازوکارهای حرارتی و مقاومتی به وسیله هر دو حسگر مورد بحث اشاره کرد.

ترتیب ارائه مطالب در تحقیق حاضر به این صورت است که ابتدا روش محاسباتی مورد استفاده و جرئیات آن تشریح شده و سپس در بخش بعدی، معتبر بودن روش محاسباتی خود را از طریق مقایسه نتایج به دست آمده برای سیلی گرافن های g-SiC و g-SiC₂ (با به کارگیری روش مذکور) با نتایج حاصل از سایر پژوهش های صورت گرفته روی این سیلی گرافن ها، نشان خواهیم داد. بعد از آن به ترتیب خصوصیات هندسی و الکترونی صفحات سیلی گرافن g-SiC و g-SiC₂ برای پایدارترین پیکربندی ترکیب آنها با گاز سولفید هیدروژن ارائه می شود. بررسی سازوکارهای متنوع حسگری صفحات سیلی گرافن مورد بحث در پاسخ به گاز سولفید هیدروژن، هدف بخش بعدی خواهد بود. در انتها نیز به جمع بندی مطالب گفته شده پرداخته و نتایج مهم حاصل از این پژوهش را بر می شماریم.

هیدروژن یکی از موضوعات مورد توجه محققان در سال های اخیر بوده است [۶ و ۷].

در میان مواد مختلفی که در طراحی حسگرها مورد استفاده قرار گرفته است، نانوساختارهای دو بعدی به دلیل دارا بودن نسبت سطح به حجم بالا، مزیت انتقال بار مستقیم میان مولکول های گاز و زیرلایه^۱ و عدم هیریدشدگی حالت های π و σ ناشی از اثر خمث در دیگر نانوساختارها، برای کاربردهای حسگری واکنش پذیری بالاتری دارند [۸ و ۹]. در بین نانوساختارهای دو بعدی، گرافن به دلیل خصوصیات برتری از قبیل هدایت الکتریکی بالا، نسبت سطح به حجم بزرگ، مناسب بودن قابلیت تحرک الکترون ها و انتقال بالستیک، در سال های اخیر برای کاربردهای حسگری مورد توجه بیشتری قرار داشته است [۱۰-۱۳]. سیلیسین، همتای سیلیکونی گرافن نیز با توجه به برخورداری از قابلیت تحرک بالای الکترون ها و به ویژه قابلیت ادغام با قطعات الکترونیکی مبتنی بر فناوری سیلیکون برای کاربردهای حسگری موضوع تحقیق بوده است [۱۴ و ۱۵]. علیرغم تمامی مزایای بر Shermande شده، یک ایراد بزرگ هر دو ماده یاد شده که مانع کاربرد الکترونیکی گستره شان می شود، گاف نواری صفر آنها است [۱۶]. از این رو تلاش پژوهشگران جهت یافتن مواد دو بعدی با گاف نواری غیر صفر به کشف و سنتز دسته جدیدی از مواد به نام سیلی گرافن ها متنه شد. سیلی گرافن ها که در حقیقت ترکیب اتم های سیلیکون و کربن بوده و ساختار خود را از گرافن به ارث می برند، انواع مختلفی در میان آنها g-SiC (تشکیل شده از ۱ اتم کربن و ۱ اتم سیلیکون در هر یاخته بسیط) و g-SiC₂ (شامل ۴ اتم کربن و ۲ اتم سیلیکون در هر یاخته بسیط) از ویژگی هایی نظیر پایداری بالا، تحمل حرارت بالا و امکان ادغام با مدارهای الکترونیکی به دلیل حضور اتم های سیلیکون در یاخته بسیط شان برخوردارند و در عمل نیز سنتز شده اند [۱۷]. با توجه به این که جذب اغلب گازها روی سیلی گرافن های g-SiC₂ و g-SiC در اثر برهم کنش های واندروانسی میان مولکول های گاز و اتم های این صفحات بوده و تغییرات شیمیایی خاصی در آنها ایجاد

¹ Substrate

² Density Functional Theory

³ Quantum ESPRESSO (QE)

دو پارامتر نیز کاملاً مشابه با معیار درنظر گرفته شده برای میزان فضای خالی است. بر این اساس، مقادیر بهینه انرژی قطع به دست آمده برای صفحه‌های g-SiC و g-SiC₂ به ترتیب Ry ۴۸ و Ry ۵۲ است. همچنین مقدار بهینه تعداد نقاط k برای هر دو صفحه $9 \times 9 \times 1$ شده است. برای به دست آوردن مکان تعادلی اتم‌ها در شبکه، فرایند واهلش ساختاری برای تمامی ترکیب‌های مورد بررسی این مقاله در هر سه راستا تا مدامی که نیروی وارد بر هر اتم حداقل 0.001 Ry/Bohr^0 برسد، ادامه یافته است. بنابراین همانطور که در بخش‌های بعدی ملاحظه می‌شود، خصوصیات ساختاری و الکترونی آنها با دقت بسیار خوبی به دست آمده است.

۳. سیلیکرافن‌های g-SiC و g-SiC₂: ارزیابی دقت محاسبات

در این بخش، با استفاده از پارامترهای ورودی و روش محاسباتی مطرح شده در بخش قبل، ویژگی‌های هندسی و الکترونی صفحه‌های سیلیکرافن C-g-SiC و g-SiC₂ خالص را به دست آورده و با نتایج حاصل از پژوهش‌های پیشین مقایسه می‌کنیم. ساختار هندسی صفحه‌های سیلیکرافن C-g-SiC و g-SiC₂، به دست آمده از محاسبات ما در شکل ۱ آورده شده است. همچنین جدول ۱ حاوی خصوصیات هندسی صفحه‌های سیلیکرافن ذکر شده مربوط به تحقیق حاضر و نتایج استخراج شده از سایر پژوهش‌ها است.

همانطور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، صفحه‌های سیلیکرافن مورد بحث کاملاً تخت بوده و اتم‌های آن بر اساس هیبریده شدن sp^2 با یکدیگر تشکیل پیوند داده‌اند. بر اساس آنچه در جدول ۱ آورده شده است نتایج حاصل از محاسبات ما در تطابق کامل با نتایج سایر پژوهش‌ها است و اختلاف ناچیزی که مشاهده می‌شود ناشی از درنظر گرفتن نیروهای واندروالسی در پژوهش حاضر است.

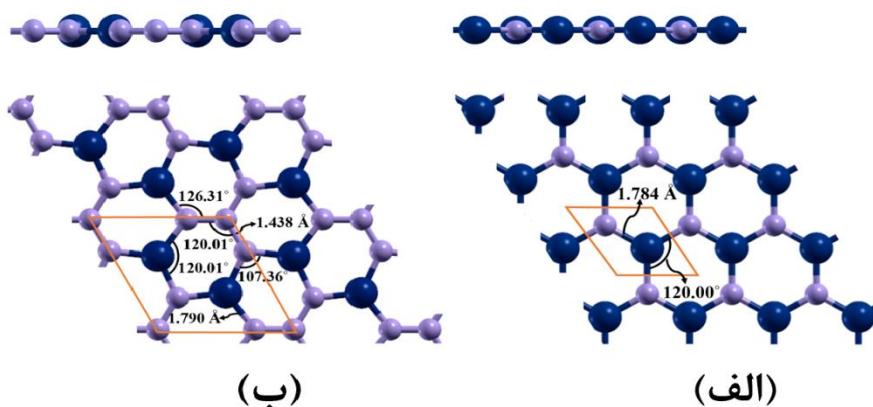
۲. جزئیات روش به کارگیری DFT در محاسبات نظری

جهت بررسی نظری جذب گاز سولفید هیدروژن روی صفحه‌های سیلیکرافن g-SiC و g-SiC₂ و تغییرات به وجود آمده در ساختار الکترونی آنها، بسته نرم افزاری کوانتمو اسپرسو [۱۹] که مبتنی بر نظریه تابعی چگالی است و از روش شبه پتانسیل برای حل معادلات کوهن-شم به طریق خودسازگار بهره می‌برد، مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه پتانسیل‌های به کار گرفته شده برای اجرای محاسبات از نوع فوق نرم بوده و همچنین برای در نظر گرفتن اثرات تبادلی-همبستگی، آنها را از نوع تابعی^۱ PBE با تقریب گرادیان تعمیم یافته^۲ (GGA) [۲۰] انتخاب کرده‌ایم. از آنجایی که برهم‌کنش بین مولکول گاز و صفحه‌های سیلیکرافن عمدتاً از نوع فیزیکی است، جهت افزایش دقت محاسبات، اثر نیروهای واندروالسی نیز از طریق روش Grimme-D2 [۲۱] در محاسبات لحاظ شده است. همچنین، در کل محاسبات آستانه همگرایی انرژی $Ry^{10^{-6}}$ در نظر گرفته شده است.

به منظور جلوگیری از برهم‌کنش بین صفحات تکرار شده به صورت دوره‌ای در راستای محور z، مقداری فضای خالی بین صفحات درنظر گرفته می‌شود. میزان این فضای خالی باید به نحوی باشد که برهم‌کنش بین صفحات به حداقل رسیده و در عین حال موجب افزایش زیاد حجم محاسبات نشود. بنابراین مقدار بهینه طول فضای خالی در راستای عمود بر صفحه‌های سیلیکرافن (محور z) مقداری است که از آن به بعد تغییرات انرژی کل ساختار خیلی ناچیز باشد. برای هر دو صفحه سیلیکرافن مورد مطالعه، مقدار بهینه فضای خالی 15 \AA به دست آمده است. انجام فرایند بهینه‌سازی برای دو پارامتر ورودی دیگر در نرم افزار نیز از قبیل مقدار انرژی قطع در بسط توابع موج بر حسب امواج تخت و تعداد نقاط k، برای نمونه برداری‌های منطقه اول بریلوئن لازم است. معیار بهینه‌سازی این

۱. Perdew-Burke-Ernzerhof

۲. Generalized Gradient Approximation



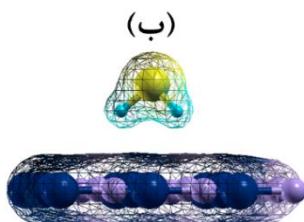
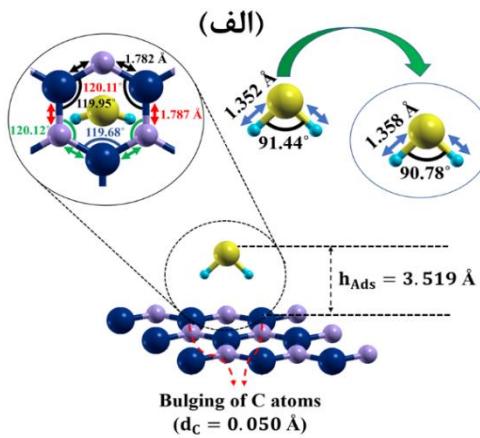
شکل ۱. ساختار هندسی صفحات سیلیکرافن (الف) g-SiC₂ و (ب) g-SiC از نمای کنار و بالا. اتم‌های سیلیسیم با رنگ سورمه‌ای و اتم‌های کربن با رنگ بنفش نمایش داده شده‌اند.

جدول ۱. ثابت شبکه، طول‌ها و زوایای پیوندی صفحه‌های g-SiC و g-SiC₂ به دست آمده از محاسبات در مقایسه با نتایج سایر پژوهش‌ها.

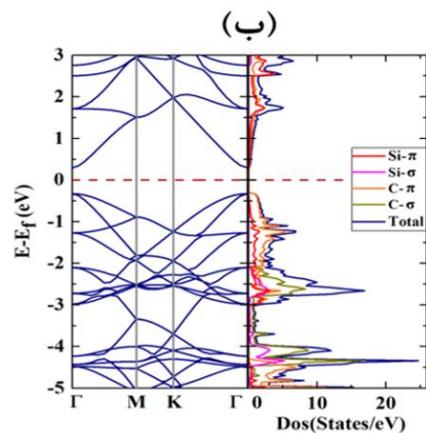
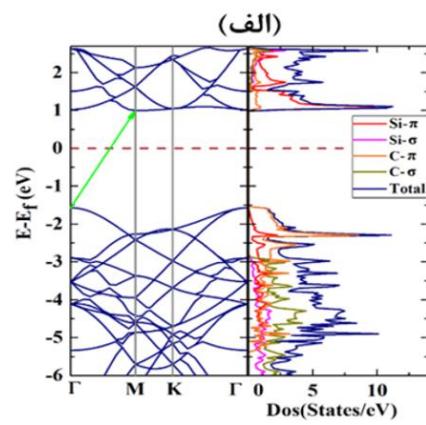
نرم افزار	زاویای پیوندی (درجه)						ثابت شبکه (Å)	ماده حسگر	مرجع
	C-C-Si	C-Si-C	Si-C-Si	C-C-C	Si-C	C-C			
QE	-	۱۲۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	-	۱/۷۸۴	-	۳/۰۹۰	g-SiC	تحقيق حاضر
DMol ³	-	-	-	-	۱/۷۷۰	-	۳/۰۷۰	g-SiC	[۲۲]
QE	-	۱۲۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	-	۱/۷۷۹	-	۳/۰۸۱	g-SiC	[۲۳]
QE	۱۲۶/۳۱	۱۲۰/۰۱	۱۰۷/۳۶	۱۲۰/۰۱	۱/۷۹۰	۱/۴۳۸	۴/۹۹۶	g-SiC ₂	تحقيق حاضر
QE	-	-	-	-	۱/۸۰۲	۱/۴۴۵	۵/۰۲۷	g-SiC ₂	[۲۴]
DMol ³	-	-	-	-	۱/۷۹۰	۱/۴۴۰	۵/۰۲۰	g-SiC ₂	[۲۵]
VASP	۱۲۶/۳۰	۱۲۰/۰۰	۱۰۷/۴۰	۱۲۰/۰۰	۱/۷۹۸	۱/۴۴۵	۵/۰۱۹	g-SiC ₂	[۲۶]

حالاتی π اتم‌های سیلیسیم به بالای انرژی فرمی منتقل شده و برای اتم‌های کربن وضعیت برعکس است. ساختار نواری به دست آمده برای سیلیکرافن g-SiC₂ (شکل ۲). ب) بیانگر این است که این ماده یک نیمرسانای ذاتی با گاف انرژی مستقیم برابر با 1.627 eV در نقطه Γ است که در انطباق با نتایج سایر گزارش‌ها (1.650 eV [۲۵] و 1.600 eV [۲۷]) است. نمودار چگالی حالات (کلی و به تفکیک حالت‌های اتمی) در شکل ۲. ب نشان می‌دهد که در اینجا نیز همانند صفحه g-SiC π عمدۀ سهم نوار ظرفیت را حالت‌های π اتم‌های کربن تشکیل می‌دهند. انطباق کامل کل نتایج ساختاری و الکترونی به دست آمده با گزارش‌های پیشین حاکی از اعتبار و دقیق بودن نتایج حاصل از محاسبات انجام شده، است.

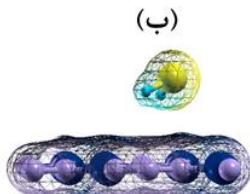
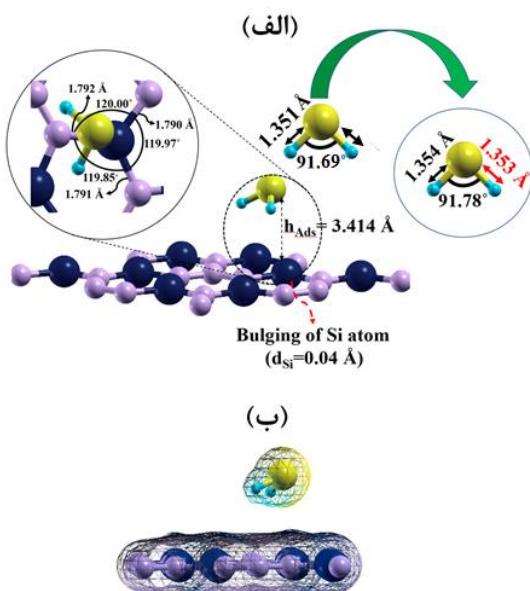
ساختار نواری و چگالی حالات الکترونی (کلی و به تفکیک حالت‌های اتمی) به دست آمده از محاسبات برای سیلیکرافن-های g-SiC₂ و g-SiC در شکل ۲ ارائه شده است. همانطور که از ساختار نواری در قسمت (الف) این شکل مشاهده می‌شود، سیلیکرافن g-SiC یک نیمرسانای غیر مستقیم نوع n با اندازه $2/563\text{ eV}$ است که این مورد نیز با مقدار گزارش شده در سایر تحقیقات ($2/550\text{ eV}$ [۲۲] و $2/580\text{ eV}$ [۲۶]) هماهنگ است. همچنین با دقت به نمودار چگالی حالات در شکل ۲. الف در می‌یابیم که نوار ظرفیت عمدتاً از حالت‌های π اتم‌های کربن تشکیل شده و عمدۀ سهم نوار هدایت به حالت‌های π اتم‌های سیلیسیم اختصاص یافته است. دلیل این امر می‌تواند الکترونگاتیویتی بیشتر اتم‌های کربن نسبت به اتم‌های سیلیسیم باشد که منجر به دور شدن الکترون‌های π از اتم‌های سیلیسیم و نزدیکی آنها به اتم‌های کربن شده است. بنابراین



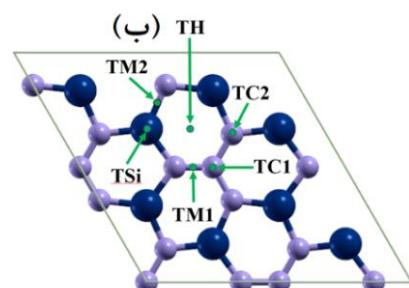
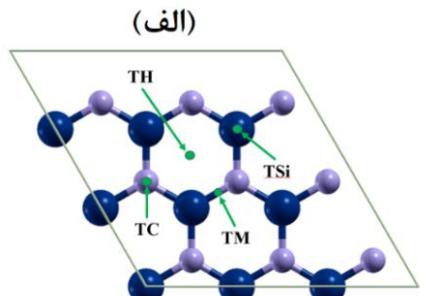
شکل ۴. (الف) ساختار هندسی صفحه g-SiC در حضور گاز سولفید هیدروژن (واهلش یافته) برای پایدارترین پیکربندی به همراه مشخصات هندسی مولکول گاز قبل و بعد از فرایند جذب و (ب) نمایش گستره توابع موج اتمی مولکول گاز و صفحه حسگر. اتم گوگرد با رنگ زرد و اتم هیدروژن با رنگ آبی نمایش داده شده است، همچنین رنگ‌های قراردادی استفاده شده برای اتم‌های صفحه همانند شکل ۱ است.



شکل ۲. ساختار نواری و نمودار چگالی حالت‌ها (کلی و به تفکیک حالت‌های اتمی) مربوط به (الف) صفحه g-SiC و (ب) صفحه g-SiC₂



شکل ۵. (الف) ساختار هندسی صفحه g-SiC₂ در حضور گاز سولفید هیدروژن (واهلش یافته) برای پایدارترین پیکربندی به همراه مشخصات هندسی مولکول گاز قبل و بعد از فرایند جذب و (ب) نمایش گستره توابع موج اتمی مولکول گاز و صفحه حسگر. رنگ‌های قراردادی استفاده شده برای اتم‌های صفحه در شکل ۴ توضیح داده شده است.



شکل ۳. مکان‌های پرتقارن (الف) برای صفحه g-SiC و (ب) برای صفحه g-SiC₂

جادب که یکی از پارامترهای ارائه شده در این جدول است، با استفاده از رابطه (۱) به دست می‌آید.

$$(1) E_{Ads} = E_{H_2S/SiliG} - E_{H_2S} - E_{SiliG},$$

در این رابطه، $E_{H_2S/SiliG}$ انرژی کل هر کدام از سیلیگرافن‌ها در حضور گاز H_2S E_{SiliG} انرژی کل صفحه سیلیگرافن به تنهایی و E_{H_2S} انرژی کل مولکول H_2S در حالت منزوی است. چنانچه انرژی جذب محاسبه شده از رابطه (۱) منفی باشد - فرایند جذب گرماده خواهد بود. همچنین پیکربندی که منفی - ترین انرژی جذب را دارد، پایدارترین پیکربندی است. دیگر پارامتر ارائه شده در این جدول ارتفاع جذب (h_{Ads}) است که به صورت فاصله عمودی (در راستای z) نزدیکترین اتم گاز تا برآمدۀ ترین اتم صفحه در ناحیه جذب تعریف می‌شود. با توجه به جدول ۲، پایدارترین پیکربندی برای جذب گاز سولفید هیدروژن روی صفحه g-SiC Λ پیکربندی Λ_{TH} است. این در حالی است که پیکربندی Λ_{TM2} معرف پایدارترین مکان جذب برای جذب گاز سولفید هیدروژن روی صفحه g-SiC₂ است. انرژی جذب پایدارترین پیکربندی صفحات C-SiC₂ و g-SiC₂ در حضور گاز سولفید هیدروژن به ترتیب MeV و -۱۹۱ MeV و -۲۰۰ MeV است که نشانگر جذب فیزیکی و گرماده مولکول گاز بر روی این صفحات است.

در شکل ۴، ساختار هندسی ترکیب صفحه g-SiC و مولکول گاز سولفید هیدروژن پس از واهلش ساختاری (قسمت (الف)), به همراه نمایش گستره توابع موج اتمی آنها (قسمت (ب)) نشان داده شده است. با توجه به شکل ۴. ب مشاهده می‌شود که در ساختار واهلش یافته، اتم‌های هیدروژن گاز به سمت اتم‌های کربن از صفحه متماطل شده‌اند. مولکول سولفید هیدروژن دوقطبی الکتریکی ذاتی دارد و اتم‌های هیدروژن سر مثبت دوقطبی را تشکیل می‌دهند. بنابراین نزدیک شدن آنها به اتم‌های کربن صفحه که به دلیل بیشتر بودن الکترونگاتیویتی آنها نسبت به سیلیسیم محل تجمع الکترون-های π هستند از نظر فیزیکی کاملاً قابل درک است. در اثر این نزدیکی و برهمنکش‌های موجود، هیریده‌شدن اتم‌های کربن از sp^2 (ساختار کاملاً مستطح) به sp^3 (ساختار چهاروجهی) کمی نزدیک شده و یک برآمدگی به اندازه 0.050 \AA در ناحیه جذب برای اتم‌های کربن مذکور ایجاد شده است.

۴. ساختار هندسی صفحه‌های سیلیگرافن g-SiC و g-SiC₂ در حضور گاز سولفید هیدروژن

برای جلوگیری از همپوشانی توابع موج مولکول‌های گاز در واحدهای تکرارشونده به صورت دوره‌ای در نرم افزار و عدم تشکیل زنجیرهایی از این مولکول‌ها، یک ابریاخته^۳ از شبکه g-SiC و 2×2 از شبکه g-SiC₂ به عنوان واحد تکرارشونده درنظر گرفته شده است. با اختصاص یک مولکول گاز به هر کدام از این ابریاخته‌ها، فاصله مولکول‌های گاز در تصویرهای دوره‌ای g-SiC₂ و g-SiC به ترتیب 0.992 \AA و 0.970 \AA می‌شود. به منظور مشخص کردن پایدارترین پیکربندی صفحه‌های g-SiC₂ در حضور گاز سولفید هیدروژن، با توجه به متفاوت بودن الکترونگاتیویتی اتم‌های گوگرد و هیدروژن، مولکول این گاز را با دو جهت‌گیری مختلف، به گونه‌ای که اتم گوگردش در فاصله عمودی معینی از نقاط پر تقارن (شکل ۳) این صفحه‌ها قرار گیرد، روی صفحات مذکور می‌گذاریم. این دو جهت‌گیری عبارتند از: ۱- اتم‌های هیدروژن گاز نسبت به اتم گوگرد از صفحه دورتر باشند (مولکول به صورت Λ شکل نسبت به صفحه) و ۲- اتم‌های هیدروژن گاز نسبت به اتم گوگرد به صفحه نزدیک‌تر باشند (مولکول به صورت Δ شکل نسبت به صفحه). قابل توجه است که علاوه بر رعایت نکات فوق برای تعریف پیکربندی‌های مختلف در فایل ورودی نرم افزار، جهت‌گیری مولکول گاز نیز طوری در نظر گرفته شده که تصویر مکان اتم‌های هیدروژن در صفحات سیلیگرافن، در مقایسه با ساختار آنها باشد.

با توجه به موارد بیان شده، ۸ پیکربندی متفاوت برای بررسی جذب مولکول گاز روی صفحه g-SiC شکل می‌گیرد که ما به دنبال تعیین پایدارترین پیکربندی پس از اجرای فرایند واهلش ساختاری برای تمامی آنها خواهیم بود. اما برای صفحه g-SiC₂، به دلیل بیشتر بودن تعداد نقاط پر تقارن آن نسبت به صفحه g-SiC (۶ عدد در مقایسه با ۴ عدد) و با در نظر گرفتن دو جهت‌گیری مولکول گاز، تعداد پیکربندی‌های شکل گرفته ۱۲ عدد است. برای مشخص کردن پایدارترین پیکربندی ترکیب‌های مورد بحث، به اطلاعات داده شده در جدول ۲ مراجعه می‌کنیم. انرژی جذب مولکول گاز سولفید هیدروژن روی صفحه‌های

جدول ۲. پیکربندی‌های جذب (قبل (اولیه) و بعد از واهلش (نهایی) ساختاری) گاز سولفید هیدروژن روی صفحه‌های g-SiC و g-SiC₂ به همراه انرژی (E_{Ads}) و ارتفاع جذب (h_{Ads}) آنها (پیکربندی‌هایی که برای معرفی آنها از نماد || استفاده شده است معرف حالتی هستند که مولکول گاز پس از اتمام فرایند واهلش تقریباً به صورت موازی با صفحه حسگر قرار گرفته است).

(h _{Ads}) (Å)	(E _{Ads}) (eV)	پیکربندی جذب		ماده حسگر
		نهایی	اولیه	
۲/۷۷۸	-۰/۱۴۳	Λ _{TC}	Λ _{TC}	
۳/۵۷۴	-۰/۰۹۸	V _{TC}	V _{TC}	
۲/۷۲۲	-۰/۱۸۳	Λ _{TSi}	Λ _{TSi}	
۳/۲۹۱	-۰/۱۵۷	_{TSi} و I _{TH}	V _{TSi}	
۲/۶۱۰	-۰/۱۹۱	Λ _{TH}	Λ _{TH}	g-SiC
۳/۳۲۷	-۰/۱۳۴	V _{TH}	V _{TH}	
۳/۳۹۹	-۰/۱۷۵	_{TSi}	Λ _{TM}	
۳/۴۹۳	-۰/۱۱۱	V _{TC} و V _{TM}	V _{TM}	
۲/۶۱۱	-۰/۱۹۰	Λ _{TC1}	Λ _{TC1}	
۳/۴۰۴	-۰/۱۱۸	V _{TC1}	V _{TC1}	
۲/۷۲۷	-۰/۱۵۶	Λ _{TC2}	Λ _{TC2}	
۳/۵۱۴	-۰/۱۰۱	V _{TC2} و V _{TM1}	V _{TC2}	
۲/۶۳۴	-۰/۱۹۰	Λ _{TH}	Λ _{TH}	
۳/۲۷۱	-۰/۱۵۲	V _{TC1} و V _{TH}	V _{TH}	
۲/۷۲۹	-۰/۱۷۶	Λ _{TSi}	Λ _{TSi}	g-SiC2
۳/۲۸۷	-۰/۱۷۱	_{TSi}	V _{TSi}	
۳/۵۷۰	-۰/۱۷۳	Λ _{TC2} و Λ _{TM1}	Λ _{TM1}	
۳/۵۳۵	-۰/۱۰۵	V _{TC1} و V _{TM1}	V _{TM1}	
۲/۷۷۵	-۰/۲۰۰	Λ _{TSi} و Λ _{TM2}	Λ _{TM2}	
۳/۳۹۷	-۰/۱۲۸	V _{TC2} و V _{TM2}	V _{TM2}	

نzedیک شدن الکترون‌های π حول اتم‌های کربن صفحه به اتم‌های هیدروژن گاز است که کاهش قطبیت پیوندها در مولکول گاز و تضعیف آنها را به دنبال دارد. همچنین این امر منجر به کاهش دافعه جفت الکترون‌های پیوندی و کوچک شدن زاویه پیوندی شده است.

گستره توابع موج اتمی که در شکل ۴. ب آورده شده، حاکی از عدم همپوشانی مؤثر توابع موج مولکول گاز و صفحه برای تشکیل پیوند شیمیایی است. بنابراین، جذب فیزیکی مولکول گاز روی صفحه g-SiC از طریق برهم‌کنش‌های واندروالسی به ویژه

علاوه بر این، از مقایسه ساختار هندسی صفحه در شکل ۱. الف در می‌یابیم که طول پیوندها و زوایای پیوندی آن بعد از جذب مولکول گاز تغییر کمی داشته است. بنابراین تقارن هندسی صفحه g-SiC در حضور گاز سولفید هیدروژن تقریباً حفظ شده که این موضوع با توجه به فیزیکی بودن فرایند جذب، دور از انتظار نیست. با توجه به ساختار مولکول گاز در شکل ۴. الف، قبل و بعد از جذب روی صفحه، مشاهده می‌شود که طول پیوندهای مولکول گاز، پس از جذب، اندکی افزایش یافته و زاویه بین آنها نیز کمی کوچک شده است. این موارد ناشی از

طول پیوندها در مولکول گاز افزایش یافته است. همچنین کاهش دافعه جفت الکترون‌های ناپیوندی گوگرد باعث افزایش زاویه پیوندی گاز شده است.

در کل، تغییرات ساختاری ایجاد شده در اثر جذب گاز، منجر به تحولاتی در خصوصیات الکترونی ترکیب نسبت به ماده حسگر اولیه می‌شود که در بخش بعد به طور مفصل بیان خواهد شد.

۵. خصوصیات الکترونی صفحه‌های سیلیکرافن g-SiC و g-SiC₂ در حضور گاز سولفید هیدروژن

ساختار نواری و نمودار چگالی حالت‌های الکترونی (کلی و به تفکیک حالت‌های اتمی) صفحه g-SiC پس از جذب مولکول گاز در شکل ۶ آورده شده است. با توجه به نمودار چگالی حالت‌ها، پهن شدگی و در نتیجه هیبریدشدگی اوریتال‌های مولکول گاز به طور عمده با حالت π اتم‌های کربن صفحه مشاهده می‌شود. احتمالاً این پدیده در اثر نزدیک شدن اتم‌های هیدروژن گاز به اتم‌های کربن صفحه (نشان داده شده در شکل ۴ از بخش قبل) است. هیبریدشدگی اوریتال δ اتم‌های هیدروژن گاز با حالت π اتم‌های کربن، منجر به جابه‌جایی بار به اندازه ۰٪۰۰ از اتم‌های کربن صفحه به سمت اتم‌های هیدروژن گاز شده است. این جابه‌جایی بار و نواحی با افزونگی (مجاور مولکول گاز) و کاستی (مجاور صفحه) بار ایجاد شده در ناحیه جذب، یک میدان الکتریکی موضعی با مؤلفه موازی با صفحه تولید کرده است. مؤلفه موازی میدان الکتریکی منجر به افزایش شب (تقر) [۲۸] نوارهای هدایت و ظرفیت می‌شود و کاهش گاف نواری را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس محاسبات صورت گرفته در مورد ساختار نواری (شکل ۶)، اندازه گاف نواری صفحه g-SiC پس از جذب گاز سولفید هیدروژن به مقدار $2/۵۴\text{ eV}$ با نقاط بیشینه نوار ظرفیت و کمینه نوار هدایت به ترتیب واقع در نقاط Γ و M (نمودار ساختار نواری) است. این میزان در مقایسه با صفحه g-SiC منزوی 15 MeV کاهش داشته که می‌تواند منجر به تغییر هدایت الکتریکی ماده حسگر شود. علاوه بر آن، جابه‌جایی بار از صفحه به سمت مولکول گاز باعث شده که صفحه g-SiC پس از جذب گاز به یک نیمرسانای نوع p تبدیل شود در حالی

برهم‌کش دوقطبی-دوقطبی (دوقطبی مولکول گاز و دوقطبی القایی در ناحیه جذب از صفحه) در اینجا نیز تأیید می‌شود. این امر موجب برگشت‌پذیری سریع حسگر بعد از اتمام استفاده از آن، بدون دخالت هیچ عامل خارجی می‌شود.

ساختار هندسی پایدارترین پیکربندی صفحه g-SiC₂ در حضور گاز سولفید هیدروژن و گستره توابع موج اتمی آنها در شکل ۵ نشان داده شده است.

همانطور که در شکل مشاهده می‌شود، ارتفاع جذب مولکول گاز روی صفحه حسگر $3/414\text{ \AA}$ به دست آمده است. همچنین گاز با اتم‌های کربن اطرافش کمی افزایش یافته ولی زوایای پیوندی به رأس اتم سیلیسیم مذکور کمی کوچک‌تر شده‌اند. در نتیجه، تقارن هندسی صفحه تقریباً حفظ شده که این امر همراه با فاصله جذب به دست آمده، تأییدی بر فیزیکی بودن فرایند جذب گاز بر روی صفحه g-SiC₂ است. به علاوه، این تغییرات بیانگر برهم‌کنش واندروالسی اتم سیلیسیم با جفت‌های ناپیوندی اتم گوگرد است. این موضوع با توجه به شکل ۵ ب. ب نیز تأیید می‌شود. در این قسمت مشاهده می‌شود که توابع موج اتم‌های گاز و صفحه همپوشانی لازم برای تشکیل پیوندهای شیمیایی مانند پیوند کوولانسی را ندارند و برهم‌کنش آنها تنها از نوع فیزیکی است.

پیش‌تر اشاره شد که الکترون‌های π از اتم‌های سیلیسیم صفحه دور شده و حول اتم‌های کربن تجمع کرده‌اند. از آنجایی که صفحه g-SiC₂ نسبت به g-SiC تعداد اتم‌های کربن بیشتری دارد، روی اتم‌های سیلیسیم آن کمبود بار بیشتری وجود دارد. بنابراین کمبود الکترون در مکان اتم‌های سیلیسیم، منجر به جذب جفت‌های ناپیوندی اتم گوگرد گاز به سمت اتم سیلیسیم شده است. در اینجا نیز برهم‌کنش مذکور هیبریده شدن اتم سیلیسیم را از sp^2 کمی به sp^3 نزدیک کرده و موجب برآمدگی آن به اندازه $0/040\text{ \AA}$ نسبت به اتم‌های اطراف در صفحه g-SiC₂ (شکل ۵. الف) شده است. علاوه براین، با کشیده شدن جفت الکترون‌های ناپیوندی گوگرد به سمت اتم سیلیسیم، بار منفی روی آن کاهش یافته و پیوندهای قطبی مولکول گاز تضعیف شده است. در شکل ۵. الف نیز مشاهده می‌شود که

(حسگرهای پلاتینی) برای آشکارسازی گاز H₂S وجود دارد. همچنین در بخش تحلیل ساختار الکترونی صفحات حسگر در حضور گاز سولفید هیدروژن، دیدیم که جذب مولکول این گاز روی صفحه‌های سیلیکرافن منجر به تغییر اندازه گاف نواری آنها نسبت به حالت منزوی به میزان ۱۵ MeV و +۱۸ MeV به ترتیب برای صفحه‌های g-SiC و g-SiC₂ می‌شود. رابطه رسانندگی الکتریکی با مقدار انرژی گاف یک ماده نیم‌رسانا به صورت رابطه (۲) [۳۰ و ۲۹] است.

$$\sigma \propto e^{\frac{-E_g}{k_B T}}, \quad (2)$$

در این رابطه، k_B ثابت بولتزمن، T دما و E_g انرژی گاف نواری است. بر اساس این رابطه، درصد تغییرات نسبی رسانندگی (میزان پاسخ حسگر) صفحات سیلیکرافن g-SiC و g-SiC₂ در اثر حضور مولکول H₂S به ترتیب برابر با +۳۸ و -۳۳ درصد در دمای اتاق خواهد بود.

علاوه بر آن، با توجه به این که g-SiC در اثر جذب مولکول‌های گاز از نیم‌رسانا نوع n به نوع p تبدیل می‌شود و تقریر نوار ظرفیت از نوار هدایت آن بیشتر است، جرم مؤثر حامل‌های بار در حضور گاز کاهش می‌یابد. این مورد نیز باعث افزایش حرکت‌پذیری حامل‌ها و در نتیجه رسانندگی بیشتر حسگر بعد از جذب گاز می‌شود. اما در مورد g-SiC₂، نوع نیم‌رسانا در حضور گاز تغییر نمی‌کند و کاهش تقریر نوار هدایت نیز در ترکیب سیلیکرافن با گاز نسبت به نوار هدایت حسگر خالص، افزایش جرم مؤثر، کاهش قابلیت حرکت الکترون‌ها و در نتیجه کاهش رسانندگی ترکیب حاصل را به دنبال دارد. بنابراین، صفحه‌های سیلیکرافن g-SiC و g-SiC₂ می‌توانند در شمار حسگرهای مقاومتی گاز H₂S قرار گیرند.

همانطور که در بالا اشاره شده نوع نیم‌رسانا ای صفحه g-SiC پس از جذب گاز تغییر می‌کند (از نیم‌رسانا نوع n به نیم‌رسانا نوع p تبدیل می‌شود) و حامل‌های اکثربیت بار آن از الکترون به حفره تبدیل می‌شود. این ویژگی صفحه g-SiC را در گروه حسگرهای مبتنی بر اثر سیبیک گاز سولفید هیدروژن جای می‌دهد. تغییر نوع نیم‌رسانا مبنای عملکرد این نوع حسگر است. شکل ۸ نمایی نوعی از یک حسگر سیلیکرافنی گاز سولفید هیدروژن مبتنی بر اثر سیبیک را به تصویر کشیده است.

که قبل از آن نیم‌رسانا نوع n بوده است. این خود یک سازوکار حسگری محسوب می‌شود که به آن اثر سیبیک می‌گویند. در بخش بعدی درباره این سازوکار حسگری به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

در شکل ۷ نمودار ساختار نواری و چگالی حالت‌های الکترونی g-SiC₂ (کلی و به تفکیک حالت‌های اتمی) ترکیب صفحه با گاز سولفید هیدروژن به نمایش در آمده است.

در اینجا بر اساس نمودار چگالی حالت‌ها، عمدتاً هیبریدشدگی اوربیتال‌های گاز سولفید هیدروژن با حالت π اتم سیلیسیم قابل ملاحظه است که دلیل این موضوع بر هم‌کنش مولکول گاز با اتم سیلیسیم (قابل مشاهده در شکل ۵ از بخش قبل) است. در اثر هیبرید شدگی اوربیتال p_z (π) اتم سیلیسیم با اوربیتال p اتم گوگرد، جایگزین جایگزین بار به اندازه ۰/۰۳۶ e از مولکول گاز به صفحه رخ داده است. همچنین جایگزین بار در ناحیه جذب، افزونگی بار منفی در نزدیکی صفحه و کاستی آن در نزدیکی اتم گوگرد را به دنبال داشته و منجر به تولید یک میدان الکتریکی موضعی عمود بر صفحه شده است. میدان الکتریکی ایجاد شده می‌تواند باعث افزایش انرژی گاف نواری در ترکیب حاصل از مولکول گاز و ماده حسگر نسبت به g-SiC₂ خالص شود. نتیجه محاسبات ساختار نواری که در شکل ۷ ارائه شده، مؤید این مطلب است و نشان می‌دهد که گاف انرژی صفحه g-SiC₂ پس از جذب مولکول گاز به میزان ۱۸ MeV در مقایسه با حالت خالص آن افزایش یافته است. قابل توجه است که در اینجا نوع ماده حسگر پس از جذب گاز تغییر نکرده و همچنان نیم‌رسانا ذاتی مستقیم با گاف نواری واقع در نقطه Γ باقی مانده است.

۶. خصوصیات و سازوکارهای حسگری صفحات سیلیکرافن g-SiC و g-SiC₂ در حضور گاز سولفید هیدروژن

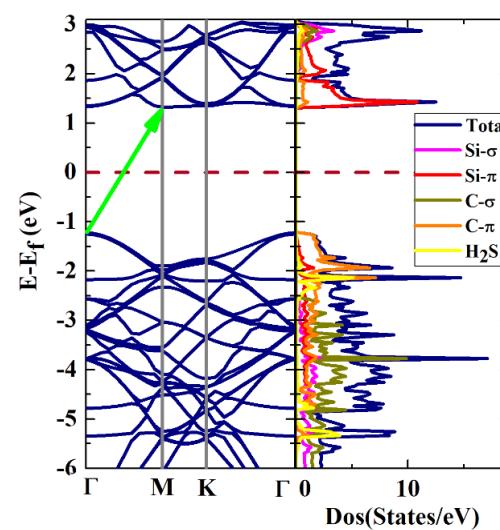
همانطور که قبلاً در بخش بررسی ساختار هندسی گفته شد، در اثر جذب گاز سولفید هیدروژن روی صفحه‌های سیلیکرافن g-SiC و g-SiC₂ به ترتیب ۲۰۰ MeV و ۱۹۱ MeV انرژی حرارتی آزاد می‌شود. بنابراین با توجه به گرماده بودن فرایند جذب، امکان استفاده از این مواد در حسگرهای بر پایه انرژی گرمایی

طرحواره ارائه شده در شکل ۸ متشکل از دو ماده نیم رسانا است که شامل صفحه g-SiC و ماده های است که امکان جذب گاز سولفید هیدروژن را ندارد. با گرم شدن قسمتی از صفحه و نیم رسانای نوع n که در نزدیکی گرم کن قرار دارند، انرژی جنبشی حامل های اکثریت آنها افزایش یافته و به سمت اتصال های فلزی (که دمای کمتری دارند) جابه جا می شوند. با توجه به این که پیش از حضور گاز بر روی صفحه حسگر، ماده g-SiC نیم رسانای نوع n است، اتصال های فلزی هر دو منفی بوده و عقره گالوانومتر منحرف نخواهد شد. ولی پس از جذب مولکول سولفید هیدروژن روی صفحه g-SiC، ترکیب حسگر با گاز، نیم رسانای نوع p می شود. در این حالت با تجمع بارهای مخالف در اتصال های فلزی، اختلاف پتانسیلی بین آنها شکل گرفته که منجر به برقراری جریان در مدار و منحرف شدن عقره گالوانومتر خواهد شد. شایان ذکر است که میزان جریان اندازه گیری شده متناسب با غلظت گاز جذب شده بر روی صفحه حسگر است.

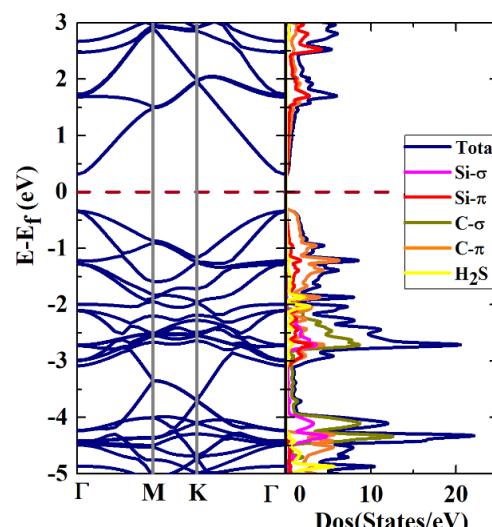
با در نظر گرفتن آنچه که در این بخش مطرح شد واضح است که صفحه های سیلیکرافن g-SiC₂ و g-SiC از قابلیت آشکار سازی گاز سولفید هیدروژن به کمک سازو کارهای حرارتی و مقاومتی برخوردارند. علاوه بر این، حسگر سولفید هیدروژن مبتنی بر صفحه g-SiC می تواند از طریق سازو کار سیبیک نیز حضور گاز سولفید هیدروژن در محیط را آشکار سازد. در خاتمه، به بررسی یکی از پارامتر های مهم در مورد حسگر گاز یعنی زمان بازیابی می پردازیم. این پارامتر امکان جداسدن سریع مولکول های گاز از سطح ماده حسگر پس از اتمام فرایند آشکار سازی را نشان می دهد. زمان بازیابی حسگر (τ) با استفاده از رابطه زیر به دست می آید [۳۱ و ۳۲].

$$\tau = A^{-1} e^{-\frac{E_{Ads}}{k_B T}}, \quad (3)$$

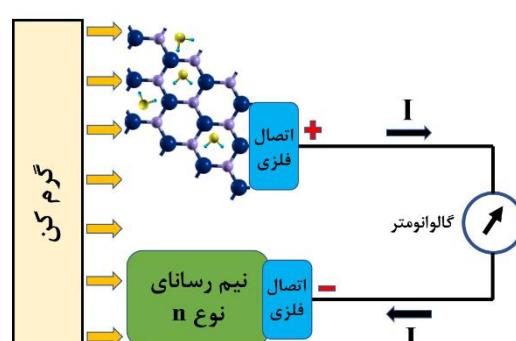
در این رابطه، A مقداری ثابت و برابر 10^{12} s^{-1} (مستقل از نوع ماده حسگر [۳۱ و ۳۲])، k_B ثابت بولتزمن، T دما و E_{Ads} انرژی جذب است. بر اساس این رابطه، زمان لازم برای بازیابی صفحه سیلیکرافن g-SiC₂ (g-SiC₂) پس از آشکار سازی گاز H₂S در دمای اتاق برابر با $1/74 \text{ ns}$ ($2/33 \text{ ns}$) است که قابلیت این حسگرها در استفاده به دفعات را نشان می دهد. این در حالی



شکل ۶. ساختار نواری و نمودار چگالی حالت ها (کلی و به تفکیک حالت های اتمی) برای صفحه g-SiC در حضور گاز سولفید هیدروژن.



شکل ۷. ساختار نواری و نمودار چگالی حالت ها (کلی و به تفکیک حالت های اتمی) برای صفحه g-SiC₂ در حضور گاز سولفید هیدروژن.



شکل ۸. ساختار نوعی از حسگر گاز سولفید هیدروژن بر پایه اثر سیبیک.

H₂S در حسگرهای مقاومتی گاز SiC و g-SiC₂ نیز وجود دارد.

- بعد از اتمام فرایند جذب، مولکول گاز روی صفحه g-SiC، نوع حامل‌های اکثربیت ماده حسگر از الکترون به حفره تغییر می‌یابد که این مورد امکان به کارگیری سیلیکرافن مذکور را در آشکارساز گاز سولفید هیدروژن مبنی بر اثر سبیک، نشان می‌دهد.
- فرایند جذب گاز سولفید هیدروژن روی هر دو صفحه سیلیکرافن فیزیکی و ناشی از برهمکنش‌های واندروالسی است. از این‌رو، بازیابی مواد حسگر پس از جذب گاز در مدت زمان خیلی کوتاهی (حدود چند نانوثانیه) صورت می‌پذیرد. بنابراین امکان استفاده مجدد از حسگرهای مبنی بر صفحات g-SiC و g-SiC₂ در زمان اندکی فراهم می‌شود.

با توجه به نتایج آورده شده در بالا، سیلیکرافن‌های g-SiC و g-SiC₂ می‌توانند از طریق سازوکارهای متنوع حسگری (حرارتی، مقاومتی و اثر سبیک) حضور گاز سولفید هیدروژن را در محیط پیرامون خود آشکار کرده، در مدت زمان اندکی پس از جذب گاز بازیابی شده و به طور مؤثری به عنوان ماده حسگر در ساخت آشکارسازهای گاز سولفید هیدروژن به کار برده شوند.

است که فرایند جذب گاز روی خوشة g-SiC و از نوع شیمیایی بوده [۱۸] و زمان بازیابی آن به مراتب بیشتر از صفحه g-SiC است.

۷. بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش با استفاده از نظریه تابعی چگالی و به کمک بسته نرم افزاری کوانتم اسپرسو، توانایی صفحات سیلیکرافن (g-SiC و g-SiC₂) در آشکارسازی گاز سولفید هیدروژن از طریق مطالعه ویژگی‌های هندسی و الکترونی این صفحه‌ها قبل و بعد از جذب گاز، مورد مطالعه قرار گرفته و سازوکارهای متنوع حسگری آنها در پاسخ به گاز مذکور معرفی شده است. اهم نتایج به دست آمده به صورت زیر است:

- فرایند جذب گاز H₂S روی هر دو صفحه گرماده است، بنابراین می‌توان از سیلیکرافن‌های g-SiC و g-SiC₂ در حسگرهای بر پایه انرژی گرمایی (حسگرهای پلاتینی) به منظور آشکارسازی گاز سولفید هیدروژن استفاده کرد.
- در نتیجه حضور گاز سولفید هیدروژن، گاف انرژی صفحه g-SiC و جرم مؤثر حامل‌های آن کاهش می‌یابد. در خصوص g-SiC₂، اما عکس این مورد اتفاق می‌افتد. در نتیجه امکان استفاده از صفحات g-

مراجع

1. A Afsari and M J Sarraf, *Superlattices and Microstructures* **138** (2020) 106362.
2. J R Kumar, et al., *Sensors and Actuators B: Chemical* **297** (2019) 126687.
3. D Raval, S K Gupta, and P N Gajjar, *Scientific Reports* **13** (2023) 699.
4. G Huang, et al., *Journal of Physics D: Applied Physics* **53** (2020) 325102.
5. W Rumbeisha, E Whitley, P Anantharam, D Kim, and A Kanthasamy, *Annals of the New York Academy of Sciences* **1378** (2016) 5.
6. J Sarfraz, D Tobjork, R Osterbacka, and M Linden, *IEEE Sensors Journal* **12** (2011) 1973.
7. R Srivastava, H Suman, S Shrivastava, and A Srivastava, *Chemical Physics Letters* **731** (2019) 136575.
8. H Dong, L Wang, L Zhou, T Hou, and Y Li, *Carbon* **113** (2017) 114.
9. R Safaiee, M M Golshan, and M. Khalifeh, *Journal of Materials Chemistry C* **10** (2022) 191.
10. C Wang, Y Wang, Z Yang, and N Hu, *Ceramics International* **47** (2021) 16367.
11. A Salmandhani, et al., *Journal of Carbon Research* **6** (2020) 74.
12. R Bogue, *Sensor Review* **34** (2014) 1.
13. M M Kadhim, et al., *Computational and Theoretical Chemistry* **1220** (2023) 113982.
14. S A Wella, M Syaputra, T D K. Wungu, and Suprijadi, AIP Conference Proceedings, 030039, 2016.
15. J Prasongkit, R G Amorim, S Chakraborty, R Ahuja, R H Scheicher, and V Amornkitbamrung, *The Journal of Physical Chemistry C* **119** (2015) 16934.

16. L J Zhou, Y F Zhang, and L M Wu, *Nano letters* **13** (2013) 5431.
17. D T Nguyen and M Q Le, *Superlattices and Microstructures* **98** (2016) 102.
18. S S Dindorkar and A Yadav, *Silicon* (2022) 1.
19. P Giannozzi, et al., *Journal of physics: Condensed matter* **21** (2009) 395502.
20. J P Perdew, K Burke, and M Ernzerhof, *Physical Review Letters* **77** (1996) 3865.
21. S Grimme, *Journal of computational chemistry* **27** (2006) 1787.
22. Z Zhao, Y Yong, Q Zhou, Y Kuang, and X Li, *ACS omega* **5** (2020) 12364.
23. N Delavari and M Jafari, *Solid State Communications* **275** (2018) 1.
24. H Shu, *Applied Surface Science* **559** (2021) 149956.
25. Y Zhao, J Zhao, and Q Cai, *Applied Surface Science* **440** (2018) 889.
26. W Li, et al., *Applied Surface Science* **509** (2020) 145193.
27. M F Saadi, R Safaiee, and M M Golshan, *Applied Surface Science* **481** (2019) 484.
28. S M Sze, and M K Lee, “Semiconductor Devices Physics and Technology,” John Wiley, USA, (2012).
29. S Nasresfahani, R Safaiee, and M H Sheikhi, *Journal of Alloys and Compounds* **757** (2018) 382.
30. K S Chan, and T J E Dwight, *Results in Physics* **10** (2018) 5.
31. I Torres, S Mehdi Aghaei, A Rabiei Baboukani, C Wang, and S Bhansali, *C-Journal of Carbon Research* **4** (2018) 44.
32. H Cui, G Zhang, X Zhang, and J Tang, *Nanoscale Advances* **1** (2019) 772.